

“素绘”大口径立式激光干涉仪 新

严格情况下，要求按照元件的使用状态测量，例如很多窗口、反射镜和半导体晶圆等。素绘300U的通光口径为300mm。为镜头上置、光路向下的结构，适合对样品的平放测量。

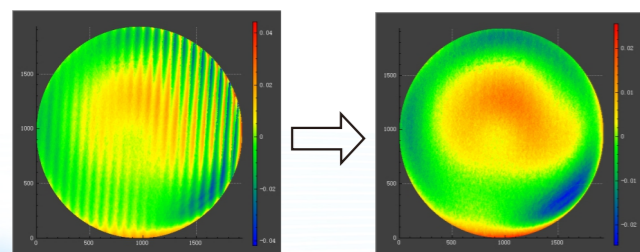


大量程测量范围

全新的光学设计提高系统传函，平面度测量范围达到150μm，帮助半导体等领域对平面度和翘曲度等的在线测量和控制。

Sirius FPSI抗振移相

在振动环境下，可以消除振动导致的波纹调制，实现稳定、可靠的测量。

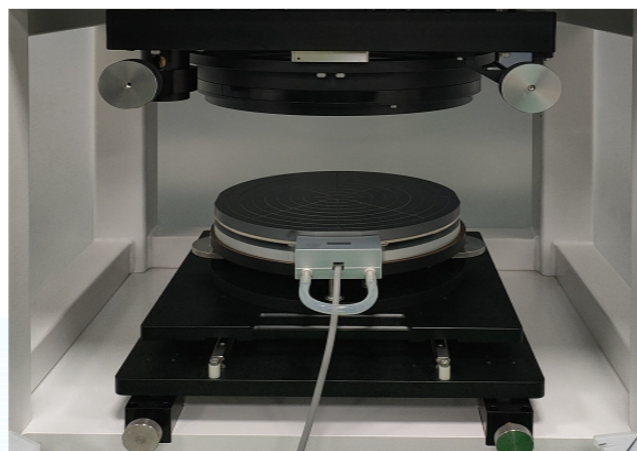


振动波纹

Sirius FPSI抗振移相模式解析

针对立式结构优化

在设计时即考虑了平面标准镜平放时重力造成的变形(Power)，在加工过程中做了对应补偿，保证仪器的整体精度。载物台集成真空发生器，便于连接气路真空吸附测量吸盘和晶圆。



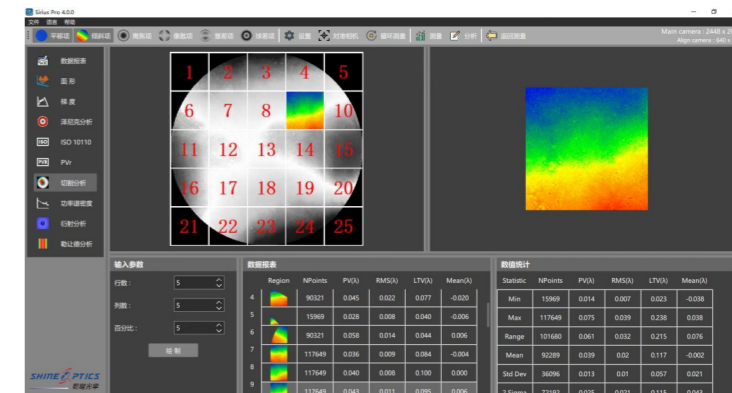
一体式抗振设计

隔振系统和仪器结构一体设计，既保证了测量的稳定性，又能使结构紧凑。载物台集成真空发生器，便于连接气路真空吸附测量吸盘和晶圆。



数据切割分析模块

切割掩模将数据按照指定的行数和列数分割，并且定义有效的百分比数据，计算出每个子区域的有效像素点、PV值、rms值、LTV值和位相平均值，以及所有区域的统计数值。



仪器规格参数表

产品型号	素绘300U	素绘WMST 300U
测量方式	菲索干涉原理	
有效通光口径	305mm	
光源	稳频氦氖激光 (632.8nm)	波长调谐激光
相机	靶面尺寸2/3", 有效分辨率2048x2048	
横向分辨率 (周期数)	全口径分辨率条纹数 > 450对 (机械移相模式)	
软件算法	Sirius抗振移相	WMST
RMS重复性 (2σ)	λ/2000	
RMS波前重复性 (mean+2σ)	< 0.6nm	
连续变焦倍数	1-6倍	
移相方式	压电陶瓷机械移相	波长移相
对准方式	十字线两点对准, 对准角度±3°	
光瞳调焦范围	±2.5m	
透射标准镜材料	进口熔石英 均匀性优于5ppm, 应力优于5nm/cm	
平面透过标准镜	PVR: 优于λ/15	
电源	100-240VAC, 50/60Hz	
尺寸 (长宽高)	1300x1200x2200mm	
重量	1000KG	